

## 新製品

## 新機能付きエッジプロファイルモナ

### 1 エッジハンドリング機能付きエッジプロファイルモナ LEP-2200FE

#### ① 概要

LEP-2200FEは、300mmウエハのフルエッジハンドリングを可能とし、ロードポート2基とクリーンユニットを搭載した、クリーンルーム対応装置です。ウエハのハンドリングをすべてエッジハンドリングで行うため、ウエハ製造工程の最終検査やデバイス製造工程の検査など、ウエハのエッジ（外周部）にしか接触できない工程にも適用が可能です。

なお、既設のLEP-2200をエッジハンドリングタイプに改造することも可能です。

#### ② 主な仕様

(LEP-2200FEのエッジハンドリング機能について)

(1) 測定時間（搬送時間も含む。ロードポートの開閉時間、プリントアウト時間は含まず）

(I) ウエハ1枚のみの測定

ノッチまたはエッジ1点のみの測定の場合 55秒

ノッチおよびエッジ9点測定の場合 145秒

(II) ウエハ連続測定

ノッチまたはエッジ1点のみの測定の場合

(2枚目以降について、1枚あたり) 45秒

ノッチおよびエッジ9点測定の場合

(2枚目以降について、1枚あたり) 135秒

(2) 搬送方式

ロボット : エッジグリッブ、ダブルハンド

ライナー : 3点支持ライナー(エッジグリッブ)

測定ステージ : エッジノッチ測定位置3点支持

エッジサポート

(3) ウエハ接触部材質

ロボットハンド : PEEK

(ハンド部はセラミック、テフロンコート)

測定ステージ : PEEK

#### ③ 特徴

フルエッジハンドリングによりウエハのクリーンな搬送が可能

#### ④ 利用分野

ウエハ製造工程の最終検査

デバイス製造工程の検査全般

#### LEP-2200FE 装置外観



### 2 ノッチ面幅測定機能付きエッジプロファイルモナ LEP-2200FN

#### ① 概要

LEP-2200FNは、300mmウエハのノッチ面幅測定が可能な、2カセット対応装置です。ウエハ上面のノッチ面幅およびウエハ下面のノッチ面幅を非接触で自動測定します。

なお、既設のLEP-2200にノッチ面幅測定機能の追加改造をすることも可能です。

#### ② 主な仕様

(LEP-2200FNのノッチ面幅測定機能について)

(1) 測定方式

照明光学系 : LED方式

撮影光学系 : CCD方式(上面用、下面用の2光学系)

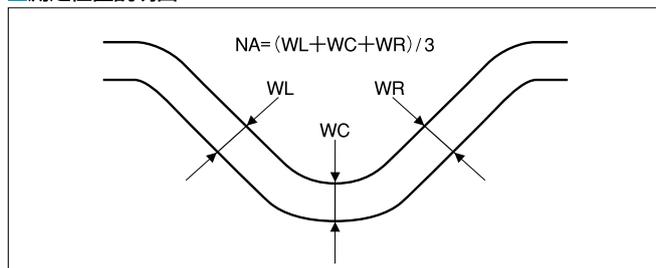
(2) 測定位置

ノッチ中央の底部(WC)、ノッチ左の直線部(WL)、

ノッチ右の直線部(WR)の面幅をそれぞれ測定し、3

つの値の平均値をノッチ面幅(NA)として出力します。

#### 測定位置説明図



(3) 繰返し測定精度

ノッチ面幅測定値NAの、10回連続測定を行った場合のσが、1.0μm以下を満足することとします。

注) 面取り面の形状などによっては、所定の性能で測定できないことがあります。

#### LEP-2200FN 測定結果表示画面例



#### ③ 特徴

ウエハ表裏面同時測定が可能

ノッチ底部および側面部3点測定

#### ④ 利用分野

シリコンウエハの面取り加工プロセス